

フラットミリング装置(日立 E-3200)のご紹介



走査型電子顕微鏡(SEM)や表面分析装置(AES、ESCA、SIMSなど)用試料の前処理装置で、アルゴンのイオンビームを試料表面に照射することにより、約5mm 径の範囲をスパッタリングすることを目的としています。

透過型電子顕微鏡(TEM)の薄膜作製にもご利用できます。

試料サイズについて

- ・利用料金は、料金表の TEM のイオンミリングをご参照下さい。
- ・利用を希望される方は、若山技術職員へ直接ご連絡下さい。

設置場所: 微細構造解析室 I

担当者: 若山 登

内線: 87-3396